# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

6

(19)日本図特許庁 (JP)

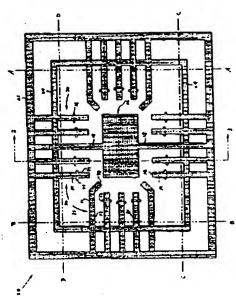
## (12) 公開特許公報(A)

(川)特許出顧公開書号 特開2000-150765 (P2000-150765A)

(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

(51) Int.CL*	識別配号	FI			5-73-1*(参考)	
HOIL 23/50		HOIL 23/50		Į	J	
11012 0700				1	H	
				1	R	
23/12		23	/28		A.	
23/28		23/12		1	F	
20120		審査請求	未請求	副東県の数32	<b>咨面 (全 19 頁)</b>	
(21)出蘇番号	特留平II-325884	(71)出題人	5991621	85		
(CI/IIII)		74	アムコー	ール テクノロ	ジー、インコーポレ	
(22)出顧日	平成11年10月12日(1989.10.12)		ーテッ	۴		
		アメリカ台衆国 アリゾナ州 8524			ノナ州 85248-	
(01) 無比佐士高士島	09/176,614		1604,	チャンドラー。	サウス ブライス	
(32) 優先日	平成10年10月21日(1998.10.21)		<b>11</b> -14	1900		
(33) 優先權主張国		(71)出版人	5991609	965		
(33) 慢光權主张區	AB (00)		アナム	セミコンダク	タ,インコーポレー	
			テッド			
					20. スンドンーク.	
				2ーガ 280-		
		(74)代理人				
		(14)142		内原音		
			7,44	. ,	最終質に続く	

(57)【要約】 (修正有) 【課題】 半導体集積回路の改良型プラスチックパッケージとその製法ならびにそのためのリートフレーム。 【解決方法】 パッケージはダイ、ダイパッド、ボンティングワイヤと封止材とからなる。金属リードフレーム 20のダイパッド22およびリード30の下側表面はエッチングにより階段状のプロフィルを形成し、ダイパッド、リードの凹んだ面を封止材で満たし、リードフレームがパッケージ本体から垂直方向に引き抜かれないようにする。またリードに耳部36を設け、パッケージ本体からリードが水平方向に引き抜かれないようにする。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体集積回路テバイス用のバッケージで あって.

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを有する全属のダイバットと

前記ダイパットの前記第1の表面に配置した半導体集積 母路デバイスと

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の風縁部で垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを各々が有する複数の全属リート ٤.

前記半導体集員回路テバイスに設けてある導電性バット と前記金属リードの前記串1の表面との間をそれそれ接 続する複数の導体と、

の前記第3の表面を窺い バッケージ本体を形成するエ ンキャプスレーション材とを含み、前記金属リードの前 記事2の表面が前記パッケージの第1の外側表面で露出 し、前紀金属リードの前記第1の表面が前記ダイバット の前記第1の平面と同一の水平面内またはその水平面以 下にあるパッケージ。

【論求項2】前記ダイパットの前記第1の表面が前記金 鷹リードの前記第1の表面と同一の水平面内にあり、前 起ダイパッドの前記第2の表面が前記パッケージの前記 第1の外側表面で露出している請求項1記銭のパッケー 30

【鯖水項3】前記金属リートの前記集2の表面が円形の 四線を有する請求項2記数のパッケーン。

【諡木項4】前記金属リートの前記第2の表面が長方形 の困難を有する請求項2記載のパッケーシ。

【請求項5】前記パッケージの前記率1の外側表面が固 辺郎を有し、前記金属リードの全部または複数の一部が その周辺部にある錦水項2 記載のバッケージ。

【論水項6】前記パッケーシの前記第1の外側表面か回 前記第2の表面が前記回辺部の内側にあって前記エンキ ャプスレーション材を前記周辺部と前記全局リートの各 4の前記第2の表面との間に留めるようにする前末項2 記載のパッケージ。

【精水項7】前記周辺部の内側に第2の表面を各りが有 する前記金属リードが前記金属リードの前記第1の表面 の反対側に実管的に平面状の第4の表面。すなわち垂直 方向には前記至属リードの前記第1の共面と前記第2の 表面との間にあり横方向には前記全属リートの前記第2 の表面と前記パッケーシの前記第1の外側表面の前記用。56。前記フレームの内側に配置されて前記フレームに接続さ

辺部との間にある第4の表面を有する請求項6記載のパ ッケージ。

【請求項8】前記パッケーシが風味側部を有し、それら 周韓側部から延びる第1の部分を複数の前記全属リート が有する請求項2記載のバッケージ。

【請求項9】前記金属リートの前記第1の部分が上向き に曲げてある請求項8記載のバッケーン。

【請求項10】前記タイパットの前記第1の表面が周縁 都を有し、前記半導体集横回路テバイスが前記ダイバッ 上の前記周縁郎を趋えて延びる議求項1記載のバッケー

【請求項】1)前記半導体業績回路テバイスが前記全属 リードの一部を絶えて延びる議求項1 O 記載のバッケー

【請求項12】前記パッケージが周縁側部辺を有し、前 記半導体集積回路デバイスの側部辺が前記回線側部辺よ りも約0.1ミリスートル以下内側にある請求項11記 貧のバッケージ。

【請求項13】前記半導体業績回路テバイスの第1の側 前記ダイパットの前記第3の表面および前記全属リート 10 部辺 すなわち前記パッケージの周棒側部辺から約(1)。 6ミリメートル内側の第1の側部辺の近傍の導電性バッ 上に導体を接続した請求項11記載のバッケーシ。 【箱水項14】厚さが約0、50ミリメートル以下の舘

水項2記載のバッケージ。

【請求項15】 耐記全属リードの前記第1の表面と前記 第3の表面との間の垂直方向の距離が前記金属リートの 前記第1の表面と前記第2の表面との間の垂直方向の距 館の約50%である請求項2記載のバッケージ。

【請求項16】前記金属リードの前記第2の表面がアレ ー状に配置されている請求項1記載のバッケージ。

【請求項17】前記金属リートの複数の一部が債方向曲 け即を含む請求項2記載のバッケーン。

【請求項18】前記全属リートの複数の一部が損方向曲 け部を含む請求項1 ()記載のバッケーン。

【請求項】9】前記ダイバットの前記第1の表面が周縁 部を有し、前記半導体集長回路デバイスが前記ダイバッ Fの前記周線部を越えて延びる請求項17記載のバッケ

【詩才項20)前記半導体集積回路テバイスが前記全局 辺郎を有し、前記金属リードの全部または複数の一部の 40 リートの一部を絶えて延びる請求項19記載のバッケー

> 【韻水項21】前記全属リートの前記年2の表面がアル -- 休に配置されていて円形の風味部を有し、それら全居 リートの複数の一部が横方向曲げ部を含む請求項1リ記 飲のバッケーン。

> 【請木項22】エンキャプスレーションを施した半導体 集構回路パッケージの製造のための金属リートフレーム てあって、

切り捨て可能な主席フレームと

れ、実質的に平面状の第1の表面と この第1の表面の 反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1 の表面の反対側の前記第2の表面の周轉部で垂直方向に 前記集1の表面および前記集2の表面の間にある実質的 に平面状の第3の表面とを有する全属のタイパットと。 前記プレームから前記ダイバットに向かってそのダイバ ッドと接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状 の第1の表面と この第1の表面の反対側にある実質的 に平面状の第2の表面と「前記第1の表面の反対側にあ り垂直方向には前記第1の表面および第2の表面の間に 10 を坐布する過程と。 ある実質的に平面状の第3の表面とを各々が含む複数の 金属リードとを含む金属リートフレーム。

【請水項23】エンキャブスレーションを施した複数の 半導体集積回路バッケージを同時並行的に製造するため のパターニングすみの金属条片であって、

複数の相互接続した切り指て可能なマトリクス状の複数 の金属フレームと、

前記プレームの各々の内側に配置されてそのフレームに 接続され、各々が実質的に平面状の第1の表面と この と、前記第1の表面の反対側の前記年2の表面の周縁部 で垂直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間 にある実質的に平面状の第3の表面とを有する金属のグ イバッドと、

前記プレームの各々から前記ダイパットに向かってその フレームの中でそのダイバッドと接触することなくそれ ぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の 表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前 紀第1の表面の反対側にあり垂直方向には前紀第1の表 面および第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の 30 表面とを含む複数の金属リードとを含むパターニングす みの全席条片。

【請水項24】半導体集機回路テバイスのためのバッケ ージを製造する方法であって、

リードフレーム。すなわち切り捨て可能な金属のフレー ムと、そのフレームの内側にあってそのフレームに接続 された全属のダイパッドであって実質的に平面状の第1 の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面 状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2 第2の表面の間にある第3の表面とを含むダイバットと を有するリードフレームであって、前記フレームから前 記ダイパッドに向かって前記タイパットに接触すること なくそれぞれ延び、実質的に平面状の寒1の表面と、こ の第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表 面と、前記第1の表面の反対側の前記年2の表面の回線 部で垂直方向に前記第1の表面もよび第2の表面の間に ある実質的に平面状の第3の表面とを各々が有する複数 の金属のリートを含むリートフレームを準備する過程

半導体集積回路テバイスを前記ダイバットの前記第1の 表面に就置する過程と、

前記半導体集員回路テバイス上の複数のポンティンタバ ッドの一つを前記リートの各々の前記第1の表面に意気 的に接続する過程と、

前記半導体集積回路テバイス。前記ダイバットおよび前 記りートの前記第1の表面および前記ダイバットおよび 前記リートの前記第3の表面を覆い前記リートの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション (1

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイバットおよび前記リートを前記プレームから切 り離し、パッケージ完成品を前記リートプレームから切 り離し、前記リードの前記第1の表面を前記タイパット の前記第1の表面と同じす平面内またはその水平面より も低い平面内に位置つける過程とを含む方法。

【請求項25】前記エンキャプスレーション材が前記タ イパットの前記第2の表面を露出させるように また前 記タイパットの前記第1の表面を前記パッケーンの前記 第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面 20 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ うに盆布される請求項24記載の方法。

【請求項26】前記ダイバットおよび前記リートの露出 した前記第2の表面を前記エンキャプスレーション材の **塗布役で前記切離しの前に左属でメッキする過程をさら** に含む請求項25記載の方法。

【請求項27】前記リードの切断を 切断後の前記リー Fの各々の第1の部分が前記エンキャプスレーション材 の外側に延びるように行う請求項25記載の方法。

【請求項28】前記リートの前記第1の部分を前記パッ ケージ本体の前記第1の表面に対して上向きに曲げる過 程をさらに合む請求事27記載の方法。

【請水項29】複数の半導体集積回路テバイスバッケー シを同時並行的に製造する方法であって、

パターニングすみの全層条件、すなわち複数の使い様で 可能な相互接続すみのマトリクス配列の金属フレームを 含むパターニングずみの金属条片であって、前記フレー ムの各々の内側にあってそのフレームに接続され 実質 的に平面状の第1の表面と この第1の表面の反対側に ある実質的に平面状の第2の表面と「前記第1の表面の の表面の周縁部で垂直方向に前記第1の表面および前記 40 反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記第1 の表面および前記第2の表面の間にある第3の表面とを 苔ャが含む全国のタイパットを有するとともに 前記で レースの各っからそのフレームの前記タイパットに向か って前記タイパットに接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状 の果3の表面とを各っか有する複数の金属のリートを有

50、するハターニングすみの金属条片を準備する過程と

前記半導体集長回路テバイスの各ヶの上の複数のホンテ ィングパットの一つをその半導体集長回路テバイスと同 一のフレーム内の一つのリートの前記第1の表面に電気 的に接続する過程と、

前記半導体集員回路テバイス。前記タイパットおよび前 記り一下の前記第1の表面および前記ダイバットおよび 前記り一トの前記第3の表面を覆い前記り一トの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション材 を盤布する過程と、

訶記エンキャブスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイパットおよび前記リートを前記フレームからそ れそれ切り難し 複数のパッケージ完成品を前記金属条 片から切り離し 一輌紀パッケージの各々の前記リードの 前記第1の表面を前記ダイバットの前記第1の表面と同 じ水平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置づ ける過程とを含む方法。

【箱水項30】前記エンキャプスレーション材が前記タ イパッドの前記第2の表面を露出させるように また前 記ダイパットの新記第1の表面を前記パッケージの前記 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ 20 うに盆布される請求項29記載の方法。

【請求項31】半導体集積回路パッケージを製造するた めの金属リードフレームを製造する方法であって 金属薄板を準備する過程と

前記金眉薄板の所定部分を除去して フレームとそのフ レーム内にあってそのフレームに接続されているダイバ ッド、すなわち実質的に平面状の第1の表面とその反対 例の実質的に平面状の第2の表面とを含むダイバッド と、繭配フレームから前記第パットに向かってそのダイ 平面状の第1の表面およびその反対側の実質的に平面状 の第2の表面を含む複数のリートとを含むリートフレー ムを形成する過程と、

前記リードフレームの前記タイパットおよびリートの一 方の側の所定の部分にパターニングすみのフォトレジス トマスクを建布する過程と

前記ダイバッドおよびリートの一部を化学的にエッチン グして前記ダイバッドおよびリートのマスクなしの部分 を除去し前記タイパッドおよび前記リートの各々に実質 的に平面状の第3の表面。すなわら前記タイパットの前。40。 記事1の表面の反対側にあり前記タイパットの前記第2 の周轉で垂直方向に前記タイパットの前記第1の長面と 前記第2の表面との間にある前記タイパットの第3の表 面」および前記リードの各々の前記甲1の表面の反対側 にあって垂直方向に前記リートの前記第1の表面と前記 リードの前記第2の表面との間にある前記リートの第3 の表面を形成する過程とを含む方法。

【請水項32】前記除去する過程がバターニングすみの フォトレジストマスクを前記全居滞板に坐布する過程

仮の所望の部分を除去する過程とを含む請求項31記載 の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は半導体集積回路で イーすなわち半導体集積回路チップのための改良型プラ スチックパッケージ。およびこの種のパッケーンを製造 するための方法およびリートプレームに関する。

(0002)

10 【発明が解決しようとする課題】半導体集積回路チップ は、有害な環境からの保護および集積回路・印刷配線回 路首板間の電気的相互接続のために プラスチックパッ ケージに通常密封する。この役のパッケージの情成要素 としては、金属リートフレーム、半導体集積回路チッ プーその半導体集積回路チャブをリートフレームに付着 させる結合材、半導体集横回路チップ上のコンタクトパ ットをリートフレームの個々のリートに意気的に接続す るポンディングワイヤヤよびこれら素子を窺ってバッケ ージ外被を形成する硬質プラスチックのエンキャプスレ ーション材などがある。

【0003】リードフレームはこの種のパッケーシの中 心的な支持構成物である。リートプレームの一部はバッ ケージの内側にあり、プラスチックのエンキャプスレー ション材に完全に取り囲まれている。リートアレームの リートの一部はバッケージから外部に延びてバッケーシ の外部接続に用いられる。

【()()()()4) 慣用のプラスチック集積回路パッケーンお よびリードフレームに関するさらに詳しい背景情報はニ ューヨーク州ニューヨーク市フィフスアヴェニュー11 パッドに接触することなくそれぞれ延び各っが実質的に 30 4所在のVan Nostrand Reinhold 社1989年発行のR. TummalaおよびE. - R ymaszewski共編の専門会「Microele ctionic Packasina Handbee kjの第8章に記載されている。

【0005】従来のプラスチックパッケージの問題点 は、内部のリードフレームのためにバッケージの小型化 が制限されることである。Rocheほか名義の米国特 許第4、530、142号ねよびCastro名鉄の米 国特許第5、172、213号に記載されているとお り 当集者はリートフレーム辞去によるパッケーン小型 化を試みたが、それらパッケーシは多数の欠点を伴う。 上記未国特許第4、530、142号記載のパッケージ のコンタクトは直交の側面を有する。したがって、コン タクトがエンキャプスレーション材から容易に引きばか されてバッケーンの信頼性が低下する。上紀末国特許第一。 5、170、213号記載のパッケージは集積回路チッ プ上のバットから上方に垂直に延びる曲げリートを備え る。このようなサートをバッケージ内に合むので製造コ ストが上がり、バッケージの小型化が阻塞される。 した と、前記全席番級を化学的にエッチングして前記主席簿。50、かって、より小さくより信頼性の高いプラスチックバッ

ケージが必要である。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は半導体集積回 路チップを収容する改良型ブラスチックバッケージ、お よびそのバッケージの製造のためのリートフレームおよ び方法にある。この発明の一つの実施圏による根立て方 <del>法における工程)では全属リートフレームを準備する。</del> そのリードフレームは切り抽て式の長方形のフレームを 含む。ダイバッドをそのフレームの中に設けてあり、そ のフレームに接続してある。フレームから横方向に複数 10 のリードがダイバッドとの接触なしにダイバッド方向に 秘びている。

【0007】リードフレームのダイバットは長方形の周 辺を有する。ダイパッドは水平な第1の表面を有し、パ ッケージ組立ての際にその上にダイを載せる。この第1 の表面の反対側には実質的に平面状の中央部の第2の表 面があり、周辺部の第3の表面がある。この第3の表面 は第2の表面の周縁にあり 第2の表面から垂直方向に 凹んでいて、ダイバッドの下側表面が階段状のブロフィ 一ルを示すようにしてある。パッケーシ充成品ではエン 20 キャプスレーション材がダイバットの上記の凹んだ第3 の表面の下側を満たしているがダイバットの第2の表面 は僕っていない。ダイバットの第3の表面の下のエンキ **♥プスレーション材はダイバットがバッケージから垂直** 方向に引っ張られるのを防止する。

【0008】 るりードは第1の表面と この第1の表面 の反対側の第2の表面と、同様に第1の表面の反対側で 第2の表面の近傍の第3の表面とを備える。第2の表面 は長方形または円形の風峰を有する。第3の表面は階段 状プロフィールのリードの下側表面に至る第2の表面か 30 **ち垂直に凹んでいる。パッケージ完成品ではリードの第** 3の表面の下をエンキャプスレーション材が満たしてい るが、リードの第2の表面を覆ってはいない。リートの 第2の表面はLCCパッケージの場合と同様にパッケー シの外部接続のためのコンタクトとして、または半田は の技能のためのランドとして作用する。リードの年3の 表面の下のエンキャプスレーション村はリードがバッケ ージから垂直に引っ張られるのを防止する。

【0009】リードフレームは色いた主席条片から2工 程は金属条片をエッチングで貫通する片面または両面エ ッチングであって、それによって、リードフレームの所 望の全体パターンを全居条片に転写する。第2のエッチ ング工程はダイの周辺およびリートの所定部分をエッチ ングする工程である。第2のエッチング工程はダイバッ ドおよびリードの厚さの一部をエッチングし、それによ って上述の垂直方向に凹んだ平面状または実質的に平面 状の第3の表面をタイパットおよびリートに形成する。 【0010】工程2ではタイパットの上側の第1平面の 上に半導体集構回路を載せる。用途に応じて、タイの面、切。は、バッケーンをキップと同号の大きさにすることもで

積はダイバットの第1の表面の面積よりも小さくする か、またはダイバットの周韓部からダイがはみ出すよう に大きくしても差し支えない。

8

【0011】工程3はダイのポンティングパットの各っ と各リートの第1の表面との間をポンティングワイヤま たは同等の導体で電気的に接続する。ホンティングワイ 十の接続を受けるリート部分は、例えば親、全その他の 全属でメッキしておく。

【ひり12】工程4はタイおよひリートフレームの上向 きの第1の表面に高枯性の粘着性エンキャプスレーショ ン村を供給する。この工程のあとエンキャプスレーショ ン村は硬化する。このエンキャプスレーション村は、タ イーホンディングワイヤーリードの第1の表面 ダイバ ットおよびリートの第3の表面、およひダイおよびリー 下の側面を覆う。タイパットおよびリートの第2の表面 はエンキャプスレーション村には覆われず、バッケーシ 下側外表面で露出している。

【0013】工程5においては、ダイバットおよびリー Fの露出した第2の表面などのサードフレーム露出表面 を「鋼、金、鉛-亜鉛半田」排、ニッケル、パラジウム ほか半田付け可能な金属で半田付けする。用途およびり ードフレーム材材によっては、工程5は省略できる。 【0014】工程6において、パッケージ完成品をエン キャプスレーションずみのリートフレームから切り離 す。より詳細に述べると、工程6はリードフレームの切 り捨て可能部分を除去する。すなわち 長方形リートフ レームなどのリードフレーム切り捨て可能部分をダイバ ッドおよびリードなどリードフレームの部品構成部分か **ら切り離す。工程4におけるエンキャプスレーションの** 

方法によっては 工程6でエンキャプスレーション材を

切ってパッケージの周辺を形成する。 【0.0.1.5】 工程6はリートフレームからリートを切断 する。この切断はダムバーの内側で行う。切断の場所に 応して、切断すみのサートの鑑部がバッケージの側部か **ら慎方向に延びる。工程6またはその後続の工程に、パ** ッケージ側部で上記切断リードの突出複都を上に曲げて リード建都がバッケージ下側外面におよびリードのエン キャプスレーション部分に傾斜角を成すようにする曲げ 工程を含めることもできる。パッケージを印刷配線基板 程温式エッチングにより形成する。第1のエッチングエー40~に半田付けする際に、バッケージ下側外面に露出したり ート水平都たけてなく切断リートの上向き曲げ搖都にも 半田を付けて、半田接続を勢めるのである。 バッケーシ の宇御表面は、バッケージ下面中心にあるタイパットの 第2の表面、リートの第2の表面およびバッケーシの下 面の狭余部分を形成しタイパッドもよびリートを互いに 分離する硬化すみのエンキャプスレーション材を含む。 【0.0.1.6】この発明のバッケージは多数の利点を値 え、大島カテバイスやアナログデバイスなど多数の用途 に有用である。このパッケージは小型化できる。例え

きる。また、バッケージをごく薄くすることもできる。 この発明によると、厚さり、 5 ミリメートル以下のバッ ケージも製造できる。さらに、リードをダイのごく近傍 に配置してポンティングワイヤの長さを最小にすること がてさる。ダイバットの露出した第2の表面を ハッケ ーン冷却に備えて半田で印刷配根基板に結合することも できる。

【0017】上述のリートフレーム バッケーンおよひ 組立て方法の多数の変形をこの明細書に記載するか。こ れらはいずれもこの発明の一部を構成するものである。 例えば、一つの代替的組立て方法では複数のパッケージ の同時並行的製造を可能にするリードフレームを用い

#### [0018]

【発明の実施の形態】図上はこの発明による半導体集積 回路テバイスバッケージ相立て方法の流れ図である。図 5は図1の方法で製造可能なこの発明によるパッケージ の実施例を示す。

【10019】図1の工程1において金属フレームを準備 図である。リードフレーム20の金属部分をそれら全層 部分以外の空間から区別するように図2(ほかの図も同 じ」では陰影を付けて見やすくしてある。

【0020】図2のリードフレーム20は、用途に応じ て、銅、銅台糸(メッキ銅)メッキ銅合金、台糸37 (ニッケル37%、銀55%の台金) 絹メッキ鋼なと 慣用のリートフレーム台金で構成する。

【0021】図2のリードフレーム20は周辺部の長方 形タイパー21と中心寄りの長方形のダムパー29とを 備える(「長方形」が「方形」を含むことは当業者には 30 朝らかであろう)。 複数のリードフレーム20を金属条 片にエッチングで形成したもの(例えば図16参照)な ど代替的実施例(図示してない)ではタイパー21を省 略してリードフレーム周辺部を除後リートフレーム間の 金属条片の一部で形成することもできる。 もう一つの代 營的実施例 (図示してない) ではタイパー21とタイパ ー21・ダムパー29間リード部分とを省略して、リー ドフレーム外側フレームをダムパー29七株成すること もできる。

パー21に接続してある。タイパット22はタムパー2 9の内側にある。二つの接続線28がタイパット22を ダムハー29およびタイパー21に接続している。図1 の工程6では、接続根30をタムバー29の内側でリー ドフレーム20から切り離す。

【0023】タイパー21からダムパー29経由でダイ パッド22の側面に向かって18本のリート30かタイ パッド22との接触なしに慎方向に延びている。 苺リー F 3 D の第1の稿部34はタイパット22の近傍に位置 する。図1の工程6において、各リートはフェルーで9~50~3種様のための十分な大きさにする。果?の表面32は

とリート30の第1の確認34との間で切り難される。 代替の実施例(図示してない)では、サート3りをタイ ハー21起点でなくダムバー39起点で設けることもで き またダムパー29 およびクイパー21 を複数の対称 配置条片で接続することもできる。

【0024】 図2に示したサートフレーム20のサート **30の位置および横方向経路は例示にすきない。これら** リートの数。位置および横方向経路は用途によって変わ る。この発明の利点は特定の半導体集積回路フィのナン 10 ティングバットの故および位置に柔軟に対処するように 設計できることである。

[0025] 図2の18本のリート30のうち14本は 直線状である。これらリートのうち4 本はダムバー29 とダイパット22との間に損方向曲げ部を含む。直接状 リート30の各々は、そのサート30の機側面から垂直 方向に突出したアンカー耳部36を有する。アンカー耳 部はほぼ長方形であり、隣接リートどうしの間で配置を 少しすらしてある。 バッケージ完成品ではこれらアンカ 一耳部36はバッケージのエンキャブスレーション材と する。図2はこの発明によるリートフレーム20の平面 20 絡み合い、パッケージ本体からリート30が水平方向に 引き抜かれることがないようにする。アンカー耳即の代 わりにリード30中の官通孔または凹みをエンキャプス レーション材との絡みに用いることもできる。

【0026】図3は図2の棟3~3で見たダムバー29 の平行部は内のリートフレーム20の断面図である。 タ イバット22および二つの互いに相対するリート30か 示してある。図示したリート30の各部分はタムバー2 9のすぐ内側から始まっている。ダイバット22および リード3(1の両方の下側表面は垂直方向に凹んた小平ま たは実質的に水平の表面を含む。

【0027】図3のダイバット22は平面状の上側の第 1の表面23 平面状の反対側の第2の表面24および 平面状の同じく反対側の第3の表面25を含む、これら 表面と直交する第1の側部表面27か年3の表面25と 第2の表面24との間にある。第3の表面25は第2の 表面24から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。 すなわち、第3の表面25は垂直方向には第1の表面2 3と年2の表面24との間に位置する。タイパット22 の中央部分は第1の表面23と第2の表面24との間の 【0022】長方形周縁を有するダイバット22をタイニ40 高さ「H」を有する。タイパット22の第3の表面25 は第2の表面24の回縁部におり、一つの実施例ではこ の第2の表面24を取り囲んている。

【0028】四3のリート30の各々は平面状の単1の 表面31を含む、第1の表面31の反対側には平面状の 第2の表面32および平面状の第3の表面33かある。 第2の表面32はタムバー29から始まりタムバー29 の内側でタイパットででに向かって少し延ひる。この実 絶例では、第2の表面32は長方形の周縁を有する。第 2の楽面の長さは用途によって変わるか。 バッケーシ 吟

12

第2の表面32とリート30のタイパット22近傍終端 34との間で延びる。第3の表面33は第2の表面32 から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んている。すなわ ち、第3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第 2の表面32との間に位置する。アンカー耳部36(図 示してない)がリード30の第3の面33近傍の債方向 側部から垂直に延びている。

【0029】図1の工程6では、リートフレーム20の エンキャプスレーションのあと、リート30をタムバー 29の内側で図2の直線A-A、B-B、C-Cおよび 10 D-D沿いに切り離す。この切断はリード30の第2の 表面32を含む部分で垂直方向に行う。 パッケージ完成 品では、切断されたリード30の各々の第2の表面32 がパッケージを直接的または間接的に外部の印刷配視基 板に接続するパッケージコンタクトとして作用する。パ ッケージ完成品ではリート30の第3の表面33はエン キャプスレーション材で覆われ、したかってパッケージ 本体の内側にある(図5)。

[0030] 図3のリードフレーム2 0のダイバッド2 2およびリード30の高さ「H」の数値例としては、約 20 O. 15乃至O. 50ミリメートル 凍さ「H1」の数 値例としては約り、075乃至0、25ミリメートルが 挙げられる。ダイパッド22の水平方向インテント 「W」の数値例としては約0.025万至0.25ミリ メートルが挙げられる(これらの敏値は図中「H」「H 1」「♥」で示した部分にも適合する)。 百分比でいう と、「H 1」の値は「H」の値、すなわち第1の表面2 3および31と第2の表面24および32との間の距離 「H」の33%乃至75%の範囲または約50%であ る。実際の数値は用途によって変動する。

【0031】図2のリードフレーム20は色取り金属条 片から湿式エッチングによって形成する。周知の通り、 化学的エッチング (化学的ミリング) は、フィトリング ラフィ、フォトレジストー および全国溶解液状化主物質 を用いて金属条件にパターンをエッチングで影成するブ ロセスである。通常は、まずフォトレジスト間をその金 厲条片の片面または両面に付着させる。次に、そのフォ トレンスト唐を所望のパターンのマスクを達して露光す る。そのフォトレジスト層を現像して硬化させ、パター のマスク形成すみの条片の片面または両面に化字物質を 分はエッチングで除去され 全居条片には所望のパター ンが残る。

[0032]図2および図3(図9 図13、図15お よび図16も同様)のリートフレーム20を形成するの に二段階エッチング処理を用いる。第1のエッチング工 程では、金属条片の平面状表面の片面または両面に付着 させたフォトレジストバターンにしたかってその条片の 片面または両面からエッチングを進める。この第1のエー50 間中は接地しており。

ッチング工程で、全居条片の誰部分を完全に除去し、図 2に側示したとおり、リートプレームの全体的なパター ンを形成する。次に、ダイバッドの風味部およびリード の所望部分を果2のフォトレジストバターンで復わない まま露出させ、エッチング除去に適した状態にする。第 2のエッチング工程ではこの第2のフォトレシストバタ ーンにしたがって一方の側からリートフレームの厚さ方 向一郎を除去する。この第2のエッチング工程で「図2 および図3のリートフレーム凹み面 すなわらタイパッ 十22の第3の表面25およびリート30のダムバー2 9内側の第3の表面を形成する。 ダムバー29の内側で は 通常は接続線28もこの第2のエッチング工程にか ける。ダイパッドおよびリードの所望部分の所望の厚み がエッチンクで除去されると、この第2のエッチング工 程を止める。すなわち、この第2のエッチング工程はダ イバットおよびリートの所望の部分を厚さ方向に部分的 にエッチング除去する。第2のエッチング工程によるエ ッチングの深さは、ダイバット22およびリート30を パッケーシ本体に留めるに十分な量のエンキャブスレー ション材がダイバット22の第3の表面25およびリー ト30の第3の表面33の下を流れるようにする必要を 満たす値とする。通常は第2のエッチング工程でダイバ ットおよびリードの厚みの約5.0%を除去するが、この 値はダイパットおよびリートの厚みの約33%乃至75 %の氣圏で定められる。エッチング処理のばらつきのた めに 第3の表面25および33は平面状でなくほぼ平 面状になるに留まり、ダイバッド22およびリート30 のエッチングした側壁は90°でなく丸みを帯びた角部 を伴うこともあろう。

【0033】リードフレーム20の形成を、順送り打抜 さにより全体的パターンを形成する工程と、打抜きすみ リードフレームのダイバットおよびリードを上述の化学 的エッチングにより厚み方向に部分的に凹み表面を形成 するように除去する工程とによって行うこともてきる。 【0034】図1の工程2において半導体集積回路タイ 52をダイパット22の第1の表面23の中央に飲せ る。パッド22へのダイ52の数層および付着は傾用の タイ付着マシンおよび慣用のダイ付着エポキシによって 行うことがてきる。この工程2およびそれ以降の組立て ニングしたフォトレジストマスクを形成する。 矢に、こ 40 工程の期間中は 図2のリードフレーム20を訴電放電 に対するダイ保護のために接地しておく。

【0035】図1の工程3では、半導体集積回路タイち 2(図5)上の個々のポンティングパットと個々のリー F 3 () の第1の表面31との間を導電性金属オンティン クワイヤ54またはその同等物で電気的に接続する。第 1の表面31は金、銀、ニッケル、バラジウム - 鋼その 他の主席でメッキすることもできる。 図2のリートアレ ーム20は、評電放電による半導体集積回路テバイスの 損傷を防ぐためにこのボンディン クワイヤ接続工程の期

【0036】図1の工程4では、図2のリートフレーム 20に高粘性の粘着エンキャプスレーション材を入れ る。エンキャプスレーション材は半導体集積回路ダイ5 2.ポンディングワイヤ54、ダイバット22の側方表 面26および27、ダイバット22の第1の表面23お よびダイ3の表面25、リード30の寒1の表面31、 第3の表面33ねよび側方表面を覆う(図5)。タイパ ッド22の第2の表面およびリート30の第2の表面3 2はエンキャプスレーション材には覆われてなく舞出し たままである。代替的実施例では、ダイバット22をエー10 ンキャプスレーション工程のあいた裏返しにして ダイ パット22の軍2の表面24の下にエンキャプスレーシ ョン村の薄い磨が形成されるようにする。その実施例で は、ダイパット22はパッケーシ本体の内部に全体が入 る。最後にエンキャプスレーション村を硬化させる。 【0037】図1の工程4を行うには用途に応じていく つかの方法がある。例えば 図1の工程4は慣用のブラ スチックモールド手法を用いて行うこともできる。その 手法では、図2のリードフレーム20を型の中におき、 図4に示すとおり、リードフレーム20の上に固体成型(20)のリードフレーム20の斜視図である。この例では、エ エンキャプスレーション村プロックを形成する。このエ ンキャプスレーション材は慣用の手法を用いて導入した 慣用のプラスチックモールド材料である。このモールド 材料としては、日本の日東電工から市販されているモー ルド村日東MP-8000ANおよび圧友から市販され ているモールド村EME7351UTなどが挙げられ る。モールド処理の円滑化のため、リードフレーム2-0 に慣用のゲートを設けることもできる。型の側面は完成 品取出しを容易にするためにテーパー状にする。

13

液状エンキャプスレーション材の利用によって行うこと もできる。例えば、図2のリードフレーム20をまず水 平表面上におく。第2のステップとして、カリフォルニ ア州インダストリー所在のDexter-Hysol社 市販のHYSOL4451エボキシなど慣用の硬化可能 な高粘性粘着材の互いに隣接するピーズをリードフレー ム20に塗布して、ダイ52の周囲およびリート30の 少なくともダムバー29内側部分に関じた長方形のダム を形成する。第3のステップとして 140℃で1時間 加熱してそのビーズを硬化させる。第4のステップとし、40 て、HYSOL4451夜廿エンキャブスレーション材 などパッケージのエンキャプスレーションに適した信用 の硬化可能な高粘性粘着材をビースの内側に塗布してタ ム内部の不完全なパッケージをエンキャプスレーション 材で覆うようにする。最後のステップとして、140℃ で ) 時間加熱してエンキャプスレーション材を硬化さ せ、リードフレーム20上にエンキャプスレーション材 の一つの固体プロックを形成する。この手法を工程4 に 用いた場合は、工程もは個を用いてエンキャプスレージ まン村を切断し、直交パッケーシ側面を形成するととも、50、の下側の第2の差面52とデーバ付き側面55とを有す

にリートフレームからパッケーシ 完成品を切り離す。同 棒のモールト処理およびそれに続く億によるリートフレ ーム・パッケージ切断工程は1998年6月24日提出 の米国特許出限第0.9/103.760号に記載されて おり ここにを照してその記載内容をこの明細書に組み 入れる。

【0039】図1の工程5では、図2のリートフレーム 20の踏都分のうち、ダイバット22の第2の長面2 4 リート3()の第2の表面32などエンキャプスレー ション材で覆われない部分を、印刷配線基板と両立性あ る慣用のメッキ金属でメッキする。このメッキ金属の例 としては、用途に応じて至、ニッケル、パラジウム、イ ンコネル、鉛糯半田、タンタルなどが挙げられる。リー トプレーム20の形成に用いた金属がメッキを要しない 全属またはメッキずみの全属である場合は工程5は省略 てきる。例えば、リードフレーム20形成用条片がニッ ケルパラジウムメッキを施した銅である場合は、工程5 は省略する。

[0040] 図4は図1の工程1-工程5終了後の図2 程4にモールド処理を用いている。硬化したエンキャブ スレーション村のブロックがパッケージ本体51を形成 する。パッケージ本体51のテーパー付き側面55はタ ムバー29の内側にある。したがって、リード30の電 出部分はパッケージ本体5~の側面5~1 とダムパー29 との間で延びている。

[10041] 図1の工程6はエンキャブスレーションず みのリードフレーム2 () (図4 ) を図2の線A - A、B - B.C-CおよびD-Dで切断する。図2を参照する 【0038】工程4のモールド処理の代わりに工程4を 30 と 工程6はダムバー29の内側でリード30を切り離 す(図3)。工程2も接続棟30をダムバー29の内側 で切り離す。最後に、工程6はパッケージ完成品をリー トプレーム20の切り捨て可能部分から切り難すことに よってパッケーン形成を充了する。

[1)042] 工程6はパンチ、総または同等の剪断装置 を用いて行う。例えば、パッケージ本体35が図5に示 すようなモールド体である場合はパンチまたは個を用い る。パンチを用いる場合は、パッケージ充成品を単一の パンチ動作でリードフレーム20から切断する。パッケ ーンを反転させて、タムバー29の内側でリート30を パンチで切断する。切断の位置は、パッケージ側面55 から延びるリート3 ()の切断部分が長さ奪ミリメートル から倒えばり、ちミリメートルの範囲に入るように変え ることができる。

【0043】図5はこの発明によるバッケージ完成品5 0の断面図である。バッケージ充成品50は図2のリー トプレーム20て製造し、図4の状態からパンチで切り 難したものである。パッケージ5-0のパッケーシ事体5 1はモール1て形成してある。 バッケーシ5 0は平面状

る. [0044] 図2のリートフレーム20から製造したパ ッケージ5 ()の構造と整合して、図5のパッケーン5 () のダイパッド22はほぼ平面状の上側の第1の表面23 を有する。ダイバット22のこの第1の表面23の反対 側には、ほぼ平面状の第2の表面24と同様にほぼ平面 状の風縁部の第3の表面25とがある。第3の表面25 は第2の表面22を取り囲んでおりその第2の表面22 から垂直方向に深さ「H1」だけ凹んでいる。第3の表 面25は垂直方向には第1の表面23と第2の表面24 10 との間に位置し、パッケージ本体51形成用のエンキャ プスレーション村で覆われている。 第3の表面25の下 のエンキャプスレーション村はダイバット22がパッケ ージから垂直方向に引っ張られるのを防ぐ。第2の表面 22はパッケージ50の下側表面56て露出し したが ってパッケージ50の下側の第2の表面56の一部を形 成する。代替的実施例では、ダイバット22はバッケー ジ本体の内部に完全に含まれる。

15

【0045】図5において、半導体集積回路ダイ52は ダイパッド22の第1の表面23に付着させてある。ダー20 イ5 2のポンディングパット5 3の各々とリート 3 ()の 第1の表面との間をポンディングワイヤ54で接続す る.

【0046】図5のパッケージ50は複数のリード30 を含み、これらリードの各々は図2のリートフレーム2 ()から第2の表面32のダムバー29の内側の点で切り 離したものである。切り離されたリード30の配置と数 はパッケージ製造に用いたリードフレームおよび用途に 応じて変わる。例えば、図2の場合のようにリード30 には直接状のものも曲げ部を含むものもある。

[0047] 図2の場合と同様に、切り離しずみのリー F31)の各々はほぼ平面状の第1の表面31と その反 対側のほぼ平面状の第2の表面32と 同様に反対側の ほぼ平面状の第3の表面33とを含む。第3の表面33 はエンキャプスレーション村による被覆を受けるように 第2の表面32から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んで いる。すなわち、第3の表面33は垂直方向には第1の 表面31と第2の表面32との間に位置する。リード3 ()の第2の表面32はエンキャプスレーション村には環 われず、パッケージ50の下側表面56て露出する。

【0048】図5において リート30の第1の表面3 1のうちパッケージ本体5 1の内部にある部分はタイパ ット22の第1の表面23と同し水平面内になる。タイ パット22をモールト内で上に上げた措造の代替の実施 例(図示してない)では、リート30の第1の表面31 のうちパッケージ本体51の内部にある部分は上がった ダイバッド22の第1の表面23よりも低い水平面内に

【0049】図5の切り離しずみのリート30の各ヶは パッケージ側面35か6換に延びる切断権部35を含った物。 パッケーショロの下側表面36の権合いに整列配置して

み、リート30の第2の表面32の残余の水平部分およ ひ下側パッケージ表面56に対し傾斜角8を成すように 曲げてある。角度hetaは約 $1.5^\circ$  乃至 $7.0^\circ$  の紀国に設定 てきる。図示のとおり、リード30の年2の表面32の 上向き曲げ終編部35は露出している。リート30のこ の曲げ終端部35の長さはバッケージ側面55から例え は0、15ミリメートルであるが、用途に応じてこの数 値は変えることができる。その数値範囲は奪ミリメート ルから約0、50ミリメートルである。

[0050] 図5のリード30の曲げ快端部35の上向 きの曲げ部は工程6においてパッケージ50をリートフ レーム20からパンチ操作で切り難すスタンピングマシ ンで形成できる。代替の実施例 (図示してない) では、 リード30の終端部35をパッケージ側面55に接触す るように、すなわら角度0を水平面とデーバー付きパッ ケージ側面55との成す角度と等しくするように曲け る。さらにもう一つの代替実施例(図示してない)で は、図1の工程6で、リート30の切断端がパッケージ 側面55から債方向にはみ出さないようにパッケージ側 面55でリード30を切断する。

[0051]代替の実施例(図示してない)では リー F30の切離しずみ端部35をパッケージ側面55から 水平面内で横方向にはみ出させる。すなわち、切離しず みの確都35を図5の場合のように曲げるのでなく、角 **度θが暴度に等しくなるようにリード3 (1の残余の部分** と同じ水平面内で横方向に延ばすのである。上記工程 6 で据を用いた場合にそのようなパッケージが得られる。 工程6に縄を用いた場合は、必要に応じて曲げ工程を別 に追加して図5の形状の上向き曲げを形成する。

【0052】図6において 半田パンプ57をパッケー ジ5.0と印刷配検益板(図示してない)との間に付着さ せる。半田パンプ57はリード30の年2の表面32に 接触し、リート30の曲げ端部35を覆っている。

[0053]代替の実施例(図示してない)では ダイ パット22の森出した第2の表面24を丰田ペーストな とで印刷配接着板に導電的に接続してバッケーン冷却に 備える。この冷却は熱伝導により行われる。

【0054】図7は図5のパッケージ50の下側表面5 6を示す。パッケージ50の第2の表面56はダイバッ - ト22の第2の表面24と - 切断ずみのリート30の第 2の表面32と 硬化すみのエンキャブスレーション材 とから成る。リード30の第2の表面36は長方形の周 縁を有する。リート30の切離しずみ終端部35は下側 表面5.6の鑑からわずかに延びている。第2の表面32 は用途によって円形その他の多様な形状と寸法にするこ とかできる。ダイパット22の第2の表面24は長方形 の周線を有するが、それ以外の形状にすることもでき

【0055】図7では、リート30の第2の表面30を

ある。リード30の切離しすみの終稿部35は下側表面 56の周縁から少し延びている。図8は代替的パッケー ジ61)の下側外表面61を示す。図8では、切離しずみ リード63の露出した長方形の第2の表面64(図9) をパッケージ60の下側表面61の端の少し内側で一列 に並べてある。これち第2の表面64はパッケージ60 の下側表面の風味から倒えば約0、05ミリノートルの 位置に配置するが、この数値は用途によって変わる。代 着の実施例 (図示してない) では、第2の表面64は長 方形でなく円形の周線を有し、相互接続用半田球ラント を形成する。

[0056] 図9は図8のバッケージ60を製造するた めのリードフレーム62のダイバット22およびリード 63のダムバー29の内側で見た断面図である。図9の リートフレーム62は図2 および図3のリートフレーム 20とほぼ同じであり、リード63の垂直方向に凹ませ た下側表面の配列、数および位置を除いてリードフレー ム20と同じ方法で製造する。したがって、重複説明は 省略する。

リード63はほぼ平面状の第1の表面31と同様にほぼ 平面状の反対側の第2の表面64とを含む。第2の表面 64はパッケーンの外部コンタクトとして作用する。し かし、図2および図3のリードフレーム20の第2の表 面の場合と異なり、図9のリード63の第2の表面64 はダムバー29(図2)のすぐ内側またはすぐ近傍には 位置せず、リード63の第3の表面66および第4の表 面65の間でダイパッド24により近く位置している。 第3の表面66と第4の表面65は第1の表面31と反 対側にあり、ほぼ平面状であり、同一平面内にあり、リー30 ード63の第2の表面64から深さ「H1」だけ垂直方 向に凹んでいる(すなわち 垂直方向には第2の表面3 1と第2の表面64との間にある)。第4の表面65は 横方向にはダムバー29(図示してないが図2の場合と 同じ) と第2の表面64との間にあり、第3の表面66 は第2の表面64とダイパッド22との間にある。

[0058] 図8および図9のリード63の第2の表面 64の国縁は多様なパッケージ外部接続を容易にするよ うに多様な影状にすることがてきる。例えば、この第2 の表面6.4 は図8の場合のように長方形の個線を備える。40 形状にすることができ、また円形の周線を備える形状に することもできる。

【0059】図10は図8のバッケーシ60の衝面図で ある。図10のバッケージは図1の処理に従い 図9の リードフレームを用いて製造する。図示のとおり 第4 の表面65はパッケージ側面55に隣接し、第2の表面 はパッケージ6 ()の下側表面6 1 の周韓建から所定距離 だけ内側にある。

【0060】図8および図10において、バッターシギ 体を形成するエンキャプスレーション材がリートの3を「10」452の下側表面89とタイパッ172の第1の差面8

その第2の表面64を除き全部覆っている。すなわら、 リート63の年3の表面66および第4の表面65はエ ンキャプスレーション材で覆われておりしたがってパッ ケージ内部にある。リードの切断蟾部がパッケージ側面 から延びている代替の実施例(例えば図5)では、エン キャプスレーンテン材はバッケージ側面から延びたりー 上切断部を雇っていない。

[()()6]]図||は図|の方法で製造可能なこの発明 によるもう一つのパッケージの断面図である。図11は 図12の根11-11で見た断面を示す。ダイ52を値 用のエポキシダイ接着剤87によりダイパッド72の上 側の第1の表面82に付着させてある。ダイ52はダイ パット72の周縁部を越え またパッケージ70のリー ト72の上側の第1の表面76を越えて延びている。し たがって、バッケージ70の大きさはチップの大きさと ほぼ間じにある。ダイ52の側面52Aとパッケーシ側 面17との間の距離はポンディングワイヤのある側では わり、6ミリメートルほどにすぎない。代替の実施例 (図示してない) では、ダイ53はダイパッド72の周 【0.0.5.7】図2のリード30の場合と同様に、図9の 20 様を越えて延びるが、リート73を越えて延びることは ない。もう一つの代替の実施例(図示してない) すな わちポンティングワイヤがダイの4辺全部になく2辺だ けにある実施例では、ポンティングワイヤの接続のない ダイ側面52Aとパッケージ辺との間の距離はごく小さ くり、1ミリメートルほどである。

[0062]図11には四つのリート73が示してあ る。二つの内側のリード73の長さの一部だけがこの図 には示してある。これら内側のリードが図13のリート フレーム71で示すとおり換方向曲げを含み、それらが 二つの外側リード73の後方にあるからである。

[0063]図11において、短いポンティングワイヤ 7.7 がダイ5.5 の上のポンティングバット 5.3 の各っと リート73の上側の第1の平面76との間に接続してお る。ポンティンクワイヤ77の第1の表面76个の接続 はリート73の年1の4886でパッケーシ側面79に輪 接して行う。

【0064】図11のパッケージ70はボールグリット アレーバッケージであるが、ラントグリップアレー(L GAIバッケーンも可能である。図12に示すとおり。 相互接続用半田球7.8のアレーをバッケージ7.0の下側 外面80に形成する。したかって、互いに異なるリート 37の第2の表面74とバッケーシ側面79との間の距 難は変わり得る(図12条畷)。

【0065】図11のバッケージ本体81はモールトし たエンキャプスレーション村で形成するが、これ以外の エンキャプスレーション方法も可能である。図1の工程 4の期間中に、ダイち2の下側表面89とリート78の 第1の表面との間をエンキャプスレーション材か満た す。非導着性(すなわら絶縁性)の結若材エホキンを?

2との間に入れ ダイ52をダイバット72に付着さ せ、ダイ52をリード73の第1の表面76の上に間隔 を隔てて保持する。また、ダイ52がリード73を趋え て延びている場合は、追加の絶縁性エポキシ87をタイ 55の下側表面89とリート73の年1の表面76との 間に入れ、ダイちちとリートで3との間に間隙を設け

【0066】図11のリート73の各々はほぼ平面状の 第1の表面76を有する。第1の表面76の反対側には 同様にほぼ平面状の第2の表面74 および第3の表面7 5がある。第2の表面74は各リード73の第1の編8 6と反対の第2の485にある。これと対称的に 図6 のパッケージ51)のリート31)の第2の表面32の位置 および図8のバッケージ60のリート63の第2の表面 64の位置はそれぞれのバッケージの下側外面の周縁上 またはその近傍にある。

[0067] 図11において、各リート73の第3の表 面75はリード73の第2の表面74に隣接しその第2 の表面7.4から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んでい る。この第3の表面75は垂直方向には第1の表面76 20 と第2の表面74との間にあり、上述のとおり図3およ び図5のリード30の第3の表面33と同じ部分エッチ ング処理で形成する。図示のとおり エンキャブスレー ション材が第3の表面75を覆い、リート73がパッケ ージ本体81から垂直方向に引っ張られるのを防いてい る。エンキャブスレーション材はリート73の年2の表 面を覆っていない。

[0068] 図11のパッケージ70の第パッド72は ほぼ平面状の第1の表面82を有する。第1の表面82 の反対側には、同様にほぼ平面状の第2の表面83と周 30 縁のほぼ平面状の第3の表面84とがある。第3の表面 84は第2の長面83を取り囲みその長面83から深さ 「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。ダイバット70の 第1の表面82はリード73の第1の表面76と同じ水 平面内にある。

【0069】図11のダイパッド72の第3の表面84 は垂直方向には第1の表面82と第2の表面83との間 にあり、図3および図5のダイバッド22の第3の表面 23と同じ部分エッチング処理で形成する。図11に示 すとおり、エンキャプスレーション村かタイパット72 40 の第3の表面84を寝い タイパット72が垂直方向に パッケージ本体81から引っ張られるのを防いている。 エンキャプスレーション材はダイバット72の第2の表 菌を覆っていない。 パッケージ冷却を容易にするため に、ダイパッド72の第2の表面83を半田はまたは同 等の導体で外部の印刷配線基板に接続することもでき る。代替的に「ダイバッド72を図1の工程4で上側に 設けて、ダイバッド72をエンキャプスレーション材で 覆いパッケージ本体81の内部に取り込むこともてき る。その場合は、リートで3の第1の美面でもはタイパーが、できた形成するリートフレームで1の数は変更できる。例

ット72の第1の表面82の下に位置づけられる。 【0070】図12は図11のパッケージ70の下側外 面80をリード73の第2の表面74に半田珠を配置す る前の状態で示した平面図である。図示のとおり 第2 の表面7.4 は円形でありアレー状に配置されている。リ ート73の第3の表面75はこの図では見えない。すな わち 第3の表面75はエンキャプスレーション計で従 われ、したがってパッケージ本体81の内部にあるから である。全属の角板88を下側表面80の四つの角の各

~に配置する。 [0071]図13は図11および図12のパッケージ 7 ()の製造に着したリードフレーム7 1の平面図であ る。図2の長方形のダイパッド22と異なり、図13の ダイバット72はダムバー29の互いに平行な二つの辺 に接続された分割型条片である。ダイバット72は四つ の長方形部分7.2を含み これら四つの部分をバッケー シ冷却のために印刷配線基板に半田球で接続する。

【0072】図13のリート73は用途に応じて多様な 形状および長さにできる。より詳細にいうと、リード7 3のいくつかはダムバー29から第2のリート後85 (図11)における円形の第2の表面74に至る痕迹部 で慎方向に真っ直ぐである。またそれらリード7-3の他 のいくつがはダムバー29と第2のリート雄85(図1 1) における第2の表面7.4 との間で一つ以上の損方向 曲げ部を有する。リートフレーム71の各角部における 二つのリード73は同一のリード蟾86に接続してある が、これは必須ではない。代替の実施例(図示してな い) では、リード73にエンキャプスレーション村との 格み合せのためのアンカー耳部を設ける。図1の工程6 において、各リート73を図13のダムバー29の内側 てリードフレーム71から切り離す。この切断はダムバ ー2 9の内側で、リートフレーム71の図13の線A -A B-B、C-CおよびD-Dにおける全居製角部材 88の端の外側で行う。

【10073】上述のパッケージ、リートフレーム 組立 て方法などには この明細書に基づき多数の変形が可能 であることは当業者に明らかであろう。例えば「四14 は、複数のパッケージを図5、図10または図11に従 って同時並行的に製造する代替組立て方法の流れ図であ る。図14の基本的工程は図1の場合と同じてあり、し たかって、各工程の詳細な説明は不要であろう。図1の 処理と図14の処理との差は複数パッケージの同時並行 製造を可能にするようにする工程が改変されていること たけである。図14の処理は工程1においてリートでも ーム20、62 71などの複数のサートフレームを一 つの全属条片シート上にマトリクスの形でエッチングに より近接形成することによって可能になる。

【① 0 7 4 】図 1 5 は全国条片 9 0 上の 1 2 個のリート アレーム71のマトリクスを示す。条片90にエッチン えば、粂片91に36個または64個のリートフレーム 91をエッチングで形成できる。リードフレーム91 は、上述の2段階エッチング手法または2段階順送りス タンピングおよび化学エッチング手法を用いて 条片 9 ()に同時並行的にエッチングで形成したものである。図 15の影状については、図14の工程4を上述のとおり 慣用のモールト手法を用いて行い、条片90の各リート フレーム71上の個々のパッケージ本体81を形成でき る。すなわち、型は各ダイに対して個々の型空間を値 え、図4の場合と同様に個々の不完全なパッケージのア 10 レーを形成する。工程6はパンチまたは総を用いて個々 のパッケージを条片9(1から切断する。

[0075]図16は8個のリードフレーム20(図 2) の二つのマトリクスをエッチングにより形成する代 替の条片93を示す。図14の工程4の期間中に個々の パッケージをモールトする代わりに 二つのマトリクス の各々のリートフレーム20全体にわたってエンキャブ スレーション村の1プロックを建布する。 これらエンキ ャプスレーション材のブロックは、図16のリードフレ ーム20の各マトリクスの周盟にHYSOL4451接 20 者剤ビーズをまず食布することによって行う。ビーズ硬 化ののち、HYSOL4450液状エンキャプスレーシ ョン村またはその同等品をピーズ内に低布し、各ダイラ 2およびダム内側の加工中のバッケージ50をエンキャ プスレーション材で覆うようにする。次に、エンキャブ スレーション村を加熱などにより硬化させ、リートプレ ーム20の二つのマトリクスの各々の上にエンキャプス レーション材の連続したプロックを形成する。図14の 工程6では、8個の期々のバッケージ50を二つの条片 93の各々から切り離すのに鋸を用いる。工程6はリー 30 ドフレーム20とダイパッド22とリード30との間を 切断する。また 工程6は直交状パッケージ側面を形成 するようにエンキャプスレーション村を切断する。

[0076] この発明の実施例の上述の説明は例示のた めのものであって限定を意図するものではない。この明 細書から、上記以外の実施例が当業者には自明である **٠**.

### 【図画の簡単な説明】

- 【図1】パッケージ製造方法の能れ図。
- 【図2】パッケージ製造に用いるリートフレームの平面 40 53 ボンディングパッド54 ボンディングワイヤ 록.
- 【図3】図2の練3-3でダムバーの内側を見たタイパ

ットおよびリートの断面図。

【図4】図2のリートフレームのモールトしたエンキャ プスレーション特によるダイ付着およびエンキャプスレ ーション後の斜視区。

22

【図5】パッケーン先成品 すなわちパッケージ本体を モールドしてパンチによりリートフレームから分離した パッケージ完成品の断面図。

【図6】リードの露出部分に半田パンプを付着させたあ との図5のパッケージの断面図。

【図7】図5のバッケージ下側表面の平面図。

【図8】代替パッケージの下側表面の平面図。

【図9】図8のバッケージの製造のためのダイバットお よびリードのダムバーの内側で見た断面図。

【図10】図8のバッケージの断面図。

【図11】ダイがダイパット周辺から機方向にリートの 長さの一部を越えてはみ出して延びている代替的バッケ - ンの新面図。

【図12】相互接続用半田球を備えない図12のバッケ - シの下側表面の平面図。

【図13】図11および図12のバッケージの製造のた めのリードフレームの平面図。

【図14】複数のパッケージを同時並行的に製造する方 法の成れ図。

【図15】全属条片のエッチングで形成した6個のリー トラレームの二つのマトリクスの平面図。

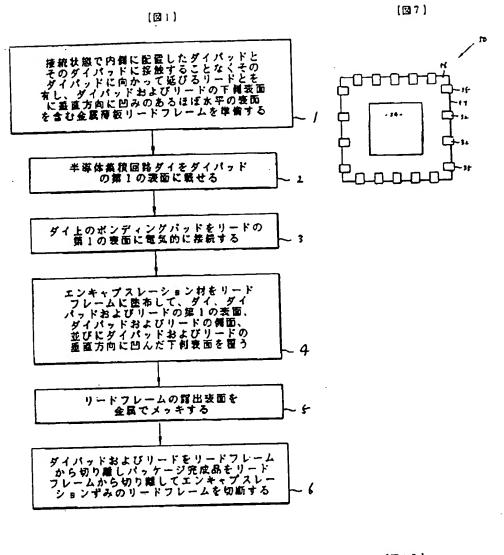
【図16】全属条片のエッチングで形成した8個のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

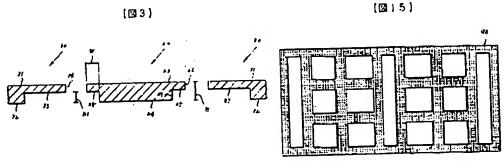
タイパー

#### 【符号の説明】

	20	リートフレーム	21	747.
,	22	ダイバッド	23	第1の表面
		第2の表面	2.5	第3の表面
		第1の直交側面	27	第2の直交側面
	28	接続提	29	ダムバー
	30	リード	3 1	第1の表面
	3.2	第2の表面	33	第3の表面
	3.4	リート先演		曲げ棺部
	36	アンカー耳部	50,	60 70 バッケー
	۶.			
	5.1	パッケーシ本体	5.2	9 1
				4. 5. 1. 10. 14.

- 55 側面56 下側表面
- 78 半田寸

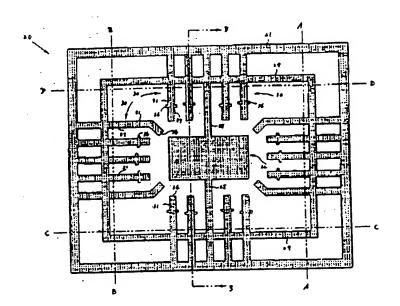


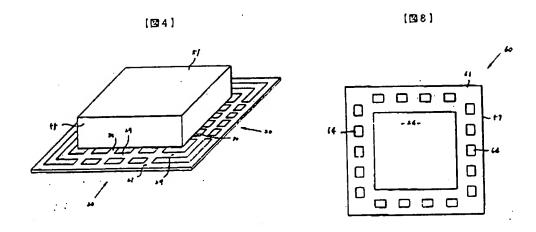


特別2000-150765

(14)

[2]2]

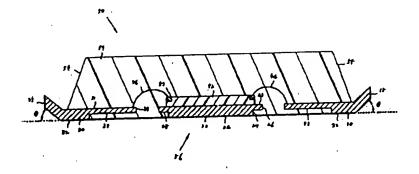




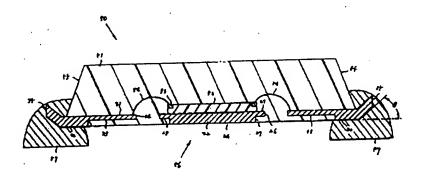
(15)

特別2000-150765

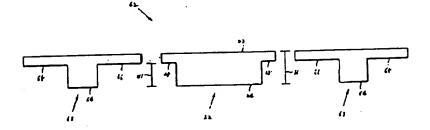
(**2**5)



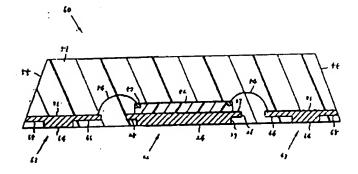
[图6]



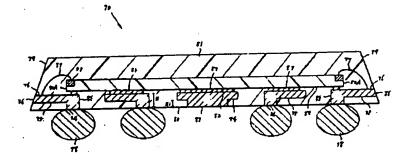
(図9)



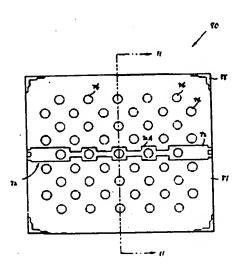
[図10]



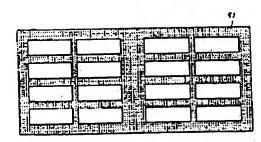
(図11)



(**3**12)



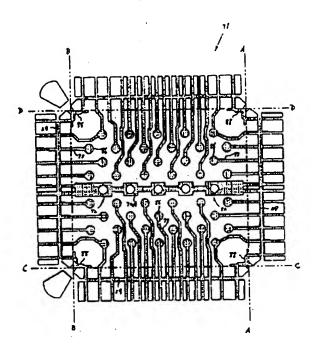
[2]16]



特闘2000-150765

(17)

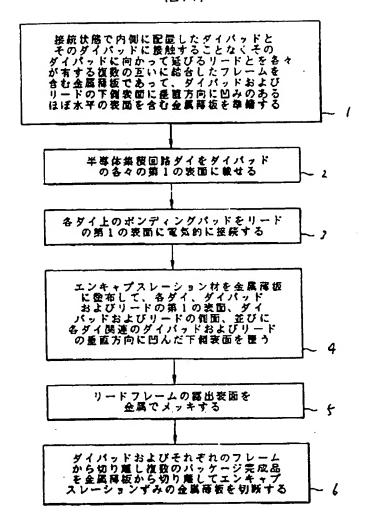
(**2**13)



3/3/03 9 38 4

map a series of specified go persystem

[214]



#### プロントページの続き

(72)発明者 トーマス ビー、グレン アメリカ台衆国 アリソナ州 85233 キ ルハート、サウス クラウン キー コー ト 1001

(72)発明者 スコット ジェイ、ジョウラー アメリカ台京園 アリソナ州 85296 キ ルバート、イースト アラヒアン コート 1436 (元)発明者 ディウェッド ロマン アメリカ合衆国 アリソナ州 85284 デ ンブル、ウェスト パロミーノ トライフ 428 1

(元)発明者 シェイ、エッチ、イー ・韓国 ソウル、カンドン・ク、アムサートン ワントンアパートメント 7-202

特別2000-150765

(72)発明者 ディー、エッチ、ムン 転割 ソウル、クヮンジンーク、クンジャ - ドン 465-7

(19)

3/3/03 9 38 Al.

1 of 2